



ArF 液浸スキャナー

NSR-S635E

Proven Solutions Through Evolution



重ね合わせ精度・スループットを向上させた 最先端プロセス量産用ArF液浸スキャナー ArF液浸スキャナーNSR-S635E

NSR-S635Eは高性能アライメントステーション「inline Alignment Station (iAS)」を搭載することで重ね合わせ精度とスループットを同時に向上させた、最先端プロセス量産用に開発された**Streamalign Platform**採用のArF液浸スキャナーです。

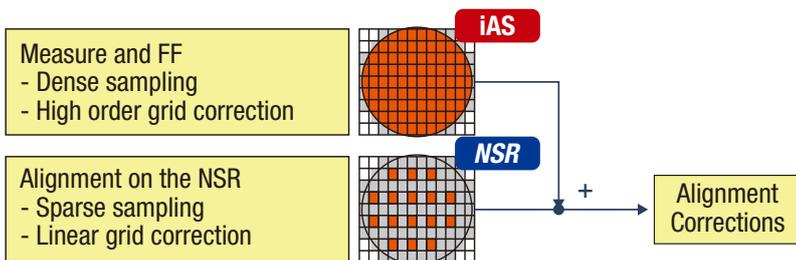
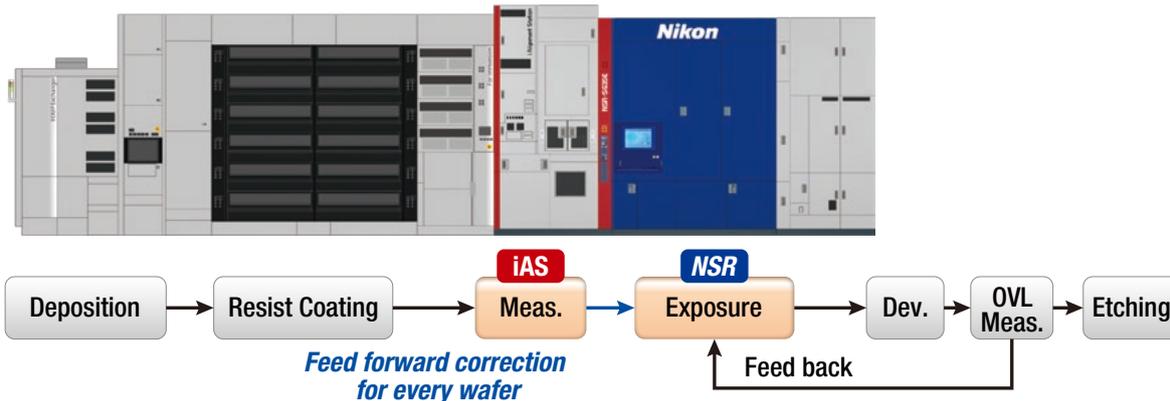
これにより、NSR-S635Eは装置間重ね合わせ精度 (MMO: Mix and Match Overlay) 2.1 nm以下、スループット毎時275枚以上 (96 shots) という極めて高い精度と生産性を実現しています。

Performance

解像度	≦ 38 nm
NA	1.35
露光光源	ArF excimer laser (193 nm wavelength)
縮小倍率	1:4
最大露光範囲	26 mm × 33 mm
重ね合わせ精度	≦ 2.1 nm (MMO*1)
スループット	≧ 275 wafers/hour (96 shots)

*1 Mix and Match Overlay: 同一機種間の重ね合わせ精度 (例 NSR-S635E#1 to S635E#2)

高性能アライメントステーション「inline Alignment Station (iAS)」の特長



アライメントステーションとは、露光装置のスループットを落とすことなく高速・高精度にウェハを計測し、グリッドエラーの補正を可能にするシステムです。これをインラインで露光装置内に組み込んだものがiASになります。iASにより、スループットを低下させることなく、全ショットでの多点アライメントが可能になり、飛躍的な精度向上を実現しました。

クラス1レーザ製品



安全に関するご注意

■ご使用の前に「使用説明書」をよくお読みの上、正しくお使いください。

ご注意

本製品および製品の技術(ソフトウェアを含む)は「外国為替および外国貿易法」に定める規制貨物等(特定技術を含む)に該当します。輸出する場合には政府許可取得等適正な手続きをお取りください。

- このカタログは2024年7月現在のものです。仕様と製品は、製造者側がなんら債務を被ることなく予告なしに変更されます。
- このカタログに掲載の会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

©2024 NIKON CORPORATION

株式会社 **ニコン**

精機事業本部 商品戦略部 140-8601 東京都品川区西大井1-5-20 電話(03)6743-5533

株式会社ニコンテック 140-0012 東京都品川区勝島1-5-21 東神ビル 電話(03)5762-8911

<https://semi.nikon.com/>